

02; 05; 07

© 1992

ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ СПЕКТРА ЗАПОЛНЕННЫХ  
СОСТОЯНИЙ  $La_{1.85}Sr_{0.15}CuO_4$  (001) ВБЛИЗИ  $E_F$   
ПО ДАННЫМ ФОТОЭЛЕКТРОННОЙ ( $h\nu$ ) = 8.43 эВ)  
СПЕКТРОСКОПИИ

А.М. А пр е л е в, А.А. Л и с а ч е н к о

Энергетический спектр заполненных состояний  $La_{1.85}Sr_{0.15}CuO_4$ ,

как и других купратных ВТСП-материалов, определяется гибридизованными  $Cu(3d)O(2p)$  орбиталями [1-4]. Ближайший к  $E_F$  пик плотности состояний характеризуется энергией связи  $E_{CB}=3.5-4$  эВ. Однако плотность состояний непосредственно на  $E_F$  и при  $E_{CB} < 3.5$  эВ отражает не только индивидуальные особенности конкретного материала, но и его ВТСП-характеристик. Так, методом УФ-фотоэлектронной спектроскопии с угловым разрешением в ФЭ-спектрах  $Bi$  (2212) обнаружены пики при  $E_{CB}=0.3, 0.65, 1.65$  эВ, интерпретация которых остается дискуссионной [5-7]. В ФЭ-спектрах и спектрах энергетических потерь [8]  $La_{2-x}Sr_xCuO_4$  проявляется слабый пик при  $E_{CB}=2.5$  эВ [8-10]. Резонанса возбуждения в области  $O2s$  не обнаружено [9], хотя он отчетливо проявляется у  $La_{1+x}Ba_{2-x}Cu_3O_{7+s}$  [11]. Отмечена неустойчивость этого пика к термообработке в сверхвысоком вакууме [8, 10], воздействию адсорбции [10] и электронного пучка [8].

Для исследования энергетического спектра заполненных электронных состояний вблизи  $E_F$  разработан специализированный УФ( $h\nu$ ) = 8.43 эВ) фотоэлектронный спектрометр [14], с помощью которого выявлена тонкая структура электронных спектров  $Y(123)$  и  $Bi$  (2212) материалов [12, 16]. Целью настоящей работы было детальное исследование электронной структуры  $La_{1.85}Sr_{0.15}CuO_4$  вблизи  $E_F$  и ее изменений под влиянием термо- и фотоактивированных процессов на поверхности.

## Э к с п е р и м е н т а л ь н а я у с т а н о в к а

Основные особенности специализированного спектрометра [12] состоят в следующем.

Для возбуждения применен ксеноновый резонансный источник ( $h\nu$ ) = 8.43 эВ). Это ограничивает доступный для анализа диапазон заполненных энергетических состояний  $E_{CB}=h\nu-\varphi_T$  величиной  $E_{CB} < 4-5$  эВ (здесь  $\varphi_T$  – термоэлектронная работа выхода, которая для исследованного образца изменялась в пределах 4-4.5 эВ). Вместе с тем появляется возможность использования сапфирового

окна, которое позволило отделить источник от сверхвысоковакуумного объема камеры анализатора, а также снизить фон более коротковолнового излучения  $Xe$  до уровня  $5 \cdot 10^{-4}$  от линии  $h\nu = 8.43$  эВ. Излучение падало под углом  $60^\circ$  к нормали, фотоэлектроны регистрировались нормально к поверхности образца. Энергоанализатор интегрального типа с задерживающим полем геометрии „плоскость-цилиндр с дном“ [14] имел разрешающую способность не хуже 80 мэВ. Воспроизводимость спектров по амплитуде была в пределах статистического разброса, по энергии – не хуже 20 мэВ. Типичная скорость счета открытого анализатора была  $2 \cdot 10^3$  имп/с при уровне шумов 0.5 имп/с. Высокопроизводительная система откачки (насос „Орбитрон“ со скоростью откачки не менее 200 л/с и рабочим вакуумом  $2 \cdot 10^{-10}$  Тор) при объеме спектрометра не более 0.5 л позволяла без прогрева установки получать вакуум  $P < 10^{-9}$  Тор через 5–10 минут после начала откачки напущенного в камеру до  $P = 0.1$  Тор газа. Использовали кислород высокой (99.99) чистоты. Состав газовой смеси контролировали непрерывно времязпролетным: масс-спектрометром [13]. Предусмотрена дополнительная засветка образца (лампа ДРШ-100, плотность мощности  $< 0.05$  Вт/см<sup>2</sup>,  $h\nu = 5.3$  эВ) непосредственно в камере образца. Образец можно было нагревать с постоянной скоростью 0.1–1 К/с, а также выдерживать при стабилизированной с точностью  $\pm 1$  К температуре в диапазоне 300–750 К или при температуре жидкого азота в вакууме или в атмосфере напускаемого газа при  $10^{-8} < P < 10^{-1}$  Тор.

## Экспериментальные результаты и обсуждение

Исследовали монокристаллы  $4 \times 3 \times 0.03$  мм  ${}^3La_{1.85}Sr_{0.15}CuO_4$ ,

выращенные бестигельной зонной плавкой, сколотые на воздухе по грани (001) и подвергнутые различным обработкам в вакууме или кислороде при  $80 < T < 750$  К. Чистую поверхность готовили длительным прогревом образца при  $T = 500$ –700 К в потоке особо чистого (99.99) кислорода при  $P = 0.1$  Тор. Подобная методика очистки разработана ранее [15] для получения поверхностей оксидов с содержанием поверхностных загрязнений не более  $10^{-6}$  монослоя. Ранее [8–10] в  $HeI$  ФЭ-спектрах и спектрах энергетических потерь обнаружили особенность при  $E_{CB} = 2.4$  эВ и заметную интенсивность спектра на  $E_F$ . Значительно более структурны спектры, снятые с использованием линии  $h\nu = 8.43$  эВ. Анализ их эволюции в ходе обработок позволил выявить наличие максимумов при следующих энергиях связи:  $E_{CB} = 0.3, 1.8, 2.2, 2.75, 3.4$  эВ. Некоторые из них показаны на рис. 1 (кривые 1–4). С увеличением накопления отчетливо выявляется порог на  $E_F$  (рис. 1, кривая 4). Низкая плотность заполненных состояний на уровне  $E_F$  может быть связана с особенностями возбуждения фотоэмиссии при  $h\nu = 8.43$  эВ. Реальность существования пиков проявляется при анализе разностей спектров, снятых до и после различных обработок (рис. 2 и 3). Так, прогрев при 620 К 20 мин в  $O_2$  ( $P = 5 \cdot 10^{-1}$  Тор) образца, обез-

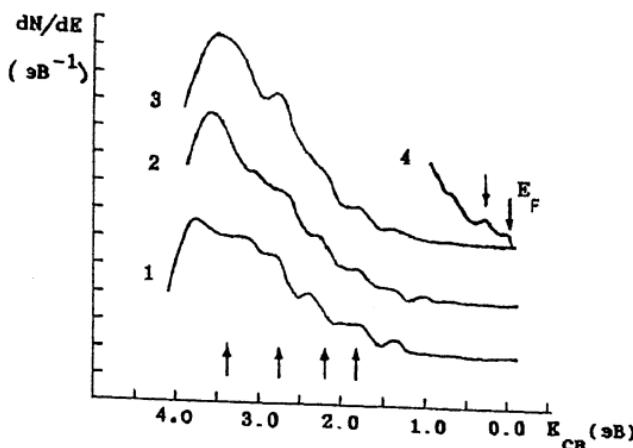


Рис. 1. ФЭ-спектры  $La_{1.85}Sr_{0.15}CuO_4$  после прогрева образца.

1 - в вакууме при 720 К 30 мин. Время накопления в точке  $t_H$  - 5 с. 2 - в  $O_2$  при 620 К 20 мин, 0.5 Тор,  $t_H$  - 5 с; 3 - в  $O_2$  при 720 К 20 мин, 0.5 Тор,  $t_H$  - 5 с; 4 - в вакууме при 620 К 30 мин,  $t_H$  - 1150 с.

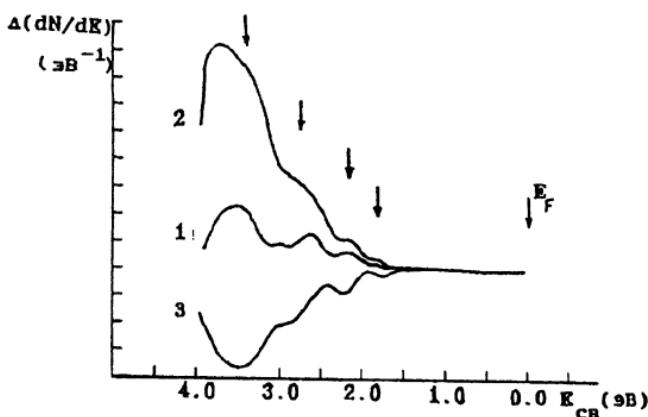


Рис. 2. Влияние условий термообработки на ФЭ-спектры  $La_{1.85}$

$Sr_{0.15}CuO_4$ . Приведены разностные спектры: 1 -  $O_2$ , 620 К 20 мин, 0.5 Тор; 2 -  $O_2$ , 720 К 20 мин, 0.5 Тор; 3 - вакуум, 720 К 30 мин, снят относительно спектра 2. Спектры 1, 2 сняты относительно спектра образца обезгаженного при 720 К 10 мин.

гаженного в сверхвысоком вакууме (720 К 10 мин), увеличивает фотоэмиссию из состояний с  $E_{CB} = 1.8, 2.2, 2.75, 3.4$  эВ (рис. 2, кривая 1). Кроме того, на 0.2 эВ увеличивается термоэлектронная работа выхода  $\mathcal{W}$ , что обнаруживается по смещению границы спектра со стороны „медленных электронов“. Это изменение естественно связать с термостимулированной адсорбцией кислорода в заряженных

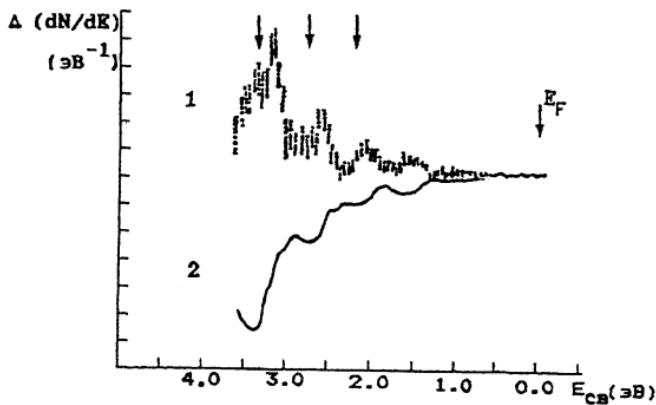


Рис. 3. Влияние условий фотообработки на ФЭ-спектры  $\text{La}_{1.85}\text{Sr}_{0.15}\text{CuO}_4$ . Приведены разностные спектры: 1 – засветка в кислороде 25 мин. 0.5 Тор. Спектр снят относительно образца, прогретого в вакууме при 520 К 35 мин. Разброс экспериментальных точек обусловлен статистической погрешностью. 2 – последующая засветка в вакууме 25 мин. Спектр снят относительно спектра 1.

формах. Дополнительный прогрев в  $\text{O}_2$  (720 К, 20 мин,  $P=0.5$  Тор) приводит к дальнейшему росту указанных пиков (рис. 2, кривая 3). Последующая термообработка в сверхвысоком вакууме при 720 К в течение 25 мин дает обратный эффект: интенсивность пиков  $E_{\text{CV}} = 1.8, 2.2, 2.75, 3.4$  эВ падает (рис. 2, кривая 3), величина  $\varphi_f$  уменьшается на 0.2 эВ.

Аналогично прогреву действует и облучение образца УФ-лампой ДРШ-100. Так, засветка 25 мин в кислороде при  $P=5 \cdot 10^{-1}$  Тор предварительно вакуумированного образца увеличивает интенсивность пиков при  $E_{\text{CV}}=2.2, 2.75, 3.4$  эВ (рис. 3, кривая 1). При этом увеличение  $\varphi_f$  на 0.1 эВ свидетельствует о заметной фотостимулированной адсорбции кислорода в заряженных формах ( $\text{O}^-$ ,  $\text{O}_2^-$ ). Последующая фотообработка в вакууме привела к уменьшению указанных пиков (рис. 3, кривая 2).

Таким образом, анализ эволюции пиков в ходе термофотоактивированных обработок поверхности позволяет выявить тонкую структуру ФЭ-спектра в области  $E_{\text{CV}} < 4$  эВ. Наряду с наблюдавшейся ранее [8–10] особенностью на 2.4 эВ обнаружены пики с  $E_{\text{CV}}=0.3, 2.0, 2.75, 3.4$  эВ. Возможность их обнаружения обусловлена, по-видимому, более высоким, чем в работах [8–10], разрешением прибора, возможностью создания контролируемых изменений газовой фазы над образцом и, вероятно, особенностями возбуждения электронов при  $h\nu=8.43$  эВ. При такой энергии конечные состояния лежат на 4–5 эВ выше  $E_F$ , не достигая максимума пика  $\text{La}4f$ . Пик 2.4 эВ практически совпадает с пиком 2.5 эВ, который наблюдали в широком диапазоне энергий возбуждения 18–40 эВ. По этой при-

чине он не может быть связан со структурой зоны конечных состояний или особенностями матричного элемента перехода. Этот пик и вся обнаруженная структура естественно объясняются, если эмиссия идет с уровней, которые в значительной степени обусловлены орбитальными, локализованными на кислороде.

Изменение интенсивности пиков вызвано обеднением или насыщением поверхности кислородом при термо- или фотообработке. Ранее аналогичный эффект наблюдали на керамике  $YBa_2Cu_xO_{7-x}$  [12]. Отсутствие большей части пиков в  $HeI$  спектрах обусловлено, по-видимому, влиянием структуры широкого энергетического спектра конечных состояний. Обращает внимание высокая эффективность фотоактивированной обработки, что позволяет регулировать заполнение состояний вблизи  $E_F$ , не изменяя температуры образца. Это может быть полезно для технологии формирования структур с использованием  $La_{1.85}Sr_{0.15}CuO_4$ -пленок.

Авторы благодарны П.О. Артамонову, А.А. Глебовскому, В.Н. Кузнецовой за помощь в работе и А.М. Ионову за обсуждение результатов.

### Список литературы

- [1] Pickett W.E. // Rev. of Modern Phys. 1989. V. 61. N 2. P. 433-512.
- [2] Kurnaev E.Z., Finkenstein L.D. // Int. J. Mod. Phys. B. 1991. V. 5. N 8. P. 1097.
- [3] Губанов В.А., Курмаев Э.З. // Журнал структурной химии. 1988. Т. 29. В. 5. С. 134.
- [4] Steiner P., Hufner S., Jungmann A. et al. // Z. Phys. B. 1989. V. 74. P. 173.
- [5] Takahashi T., Matsuyama H. et al // Phys. Rev. B. 1989. V. 39. N 10. P. 6636.
- [6] List R.S., Arko A.J., Bartlett R.J. et al. // Phys. C 1989. V. 159. P. 439.
- [7] Flavel W.R., Laverty J.H., Law D.S.-L. et al. // Phys. Rev. B, 1991. V. 44. N 2. P. 878.
- [8] Grazulis V.A., Melchenko G.A., Ionov A.M. // Phys. Scripta. 1990. V. 41. P. 555.
- [9] Kuritz R.L., Robey S.W., Stockbaumer R.L. et al. // Phys. Rev. B. 1989. V. 39. N 7. P. 4768.
- [10] Kuritz R.L., Stockbaumer R.L., Madey Th.E. // Phys. Rev. B. 1988. V. 37. N 13. P. 7936.
- [11] Lindberg P.A., Shen Z.-X., Huang J. et al. // Sol. State Comm. 1989. V. 69. N 1. P. 27.

- [12] Глебовский А.А., Клейменов В.И., Лисаченко А.А. // Сверхпроводимость. Физика, химия, техника. 1990. Т. 3. В. 9. С. 2031.
- [13] Моисеенко И.Ф., Глебовский А.А., Лисаченко А.А. // Поверхность. Физика, химия, механика. 1987. № 7. С. 116.
- [14] Клейменов В.И., Галль Л.Н., Медынский Г.С., Хасин Ю.И. // ПТЭ. 1986. В. 6. С. 144.
- [15] Лисаченко А.А., Скорняков Ю.Ф. // Поверхность. 1982. № 9. С. 54.
- [16] Апрелев А.М., Лисаченко А.А., Ионов А.М. // Письма в ЖТФ. 1992. Т. 18. В. 23.

Поступило в Редакцию  
8 июля 1992 г.